



Veranstalter / Organizer



Veranstaltungspartner / Event partner

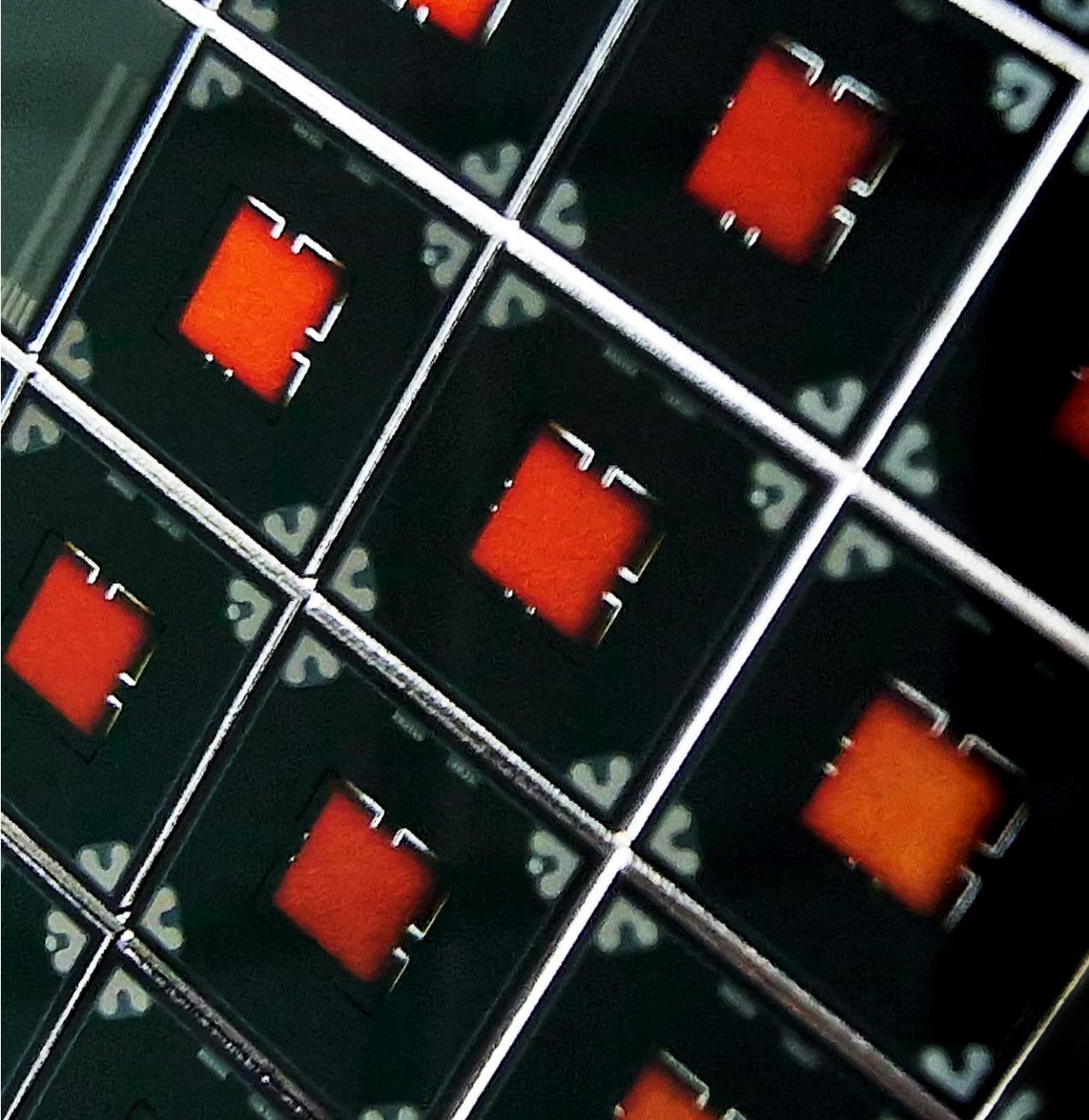
CiS Workshops 2024

MOEMS Workshop: „NDIR-Sensorik von der Komponente bis zum System“

Mittwoch, 23. Oktober 2024

MEMS Workshop: „Neue Methoden bei der Entwicklung & Anwendung von Siliziumsensoren“

Mittwoch, 6. November 2024



Neue Methoden bei der Entwicklung & Anwendung von Siliziumsensoren

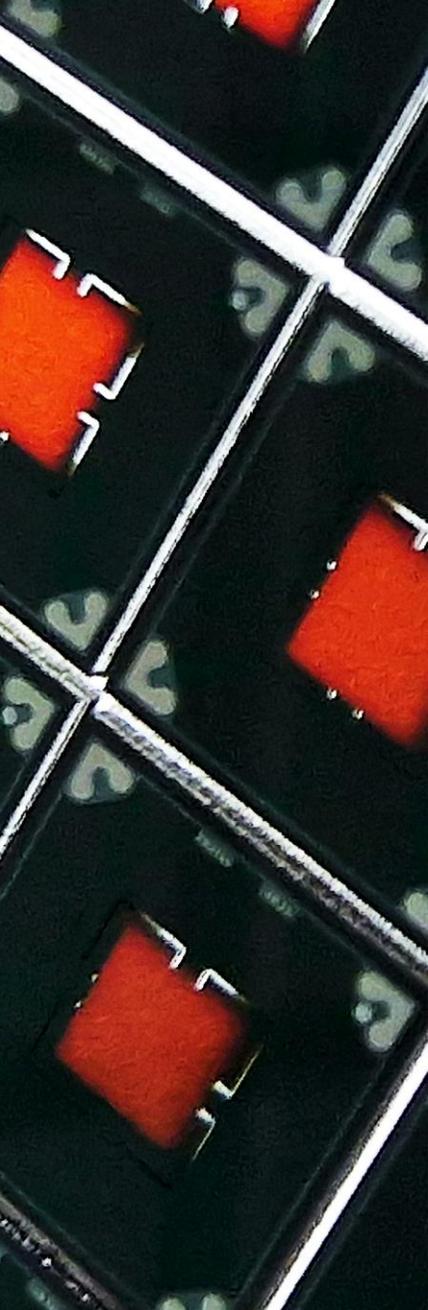
CiS MEMS Workshop am 6. November 2024

Der Workshop „Neue Methoden bei der Entwicklung & Anwendung von Siliziumsensoren“ am 6. November 2024 legt den Fokus auf Entwicklungen in den Bereichen

- Sensorelemente,
- Aufbau- und Verbindungstechnik sowie
- Charakterisierung von Sensoren, insbesondere Drucksensoren und Dehnmessstreifen in ausgewählten Anwendungsgebieten.

Gerade vor dem Hintergrund von Energieeinsparungen, dem Verlangen nach redundanten Sicherheits-systemen mit leistungsstarken, miniaturisierten Sensoren eröffnen siliziumbasierte, piezoresistive Sensoren vielfältige Möglichkeiten.

Der ganztägige Workshop in Erfurt ist als Hybridveranstaltung konzipiert und wird vom CiS e.V. ausgerichtet.



CiS MEMS Workshop Agenda I

09:30 **Registrierung & Get Together**

10:00 **Begrüßung**

Olaf Brodersen, CiS e.V.

10:15 **Keynote: KI und Sensoren**

Martin Golz, Hochschule Nordhausen

SESSION I

10:45 **Submounts**

Arthur Rönisch, duotec GmbH

11:10 **Einsatz von MEMS-Systemen in E+H-Produkten**

Raphael Kuhnen, Endress+Hauser SE+Co. KG

11:35 **MITTAGSPAUSE**

SESSION II

12:30 **Redundante Temperatursensoren**

Ingo Tobehn-Steinhäuser, CiS Forschungsinstitut

12:55 **HEB - High End Beschleunigungssensoren**

Stefan Völlmeke, CiS Forschungsinstitut

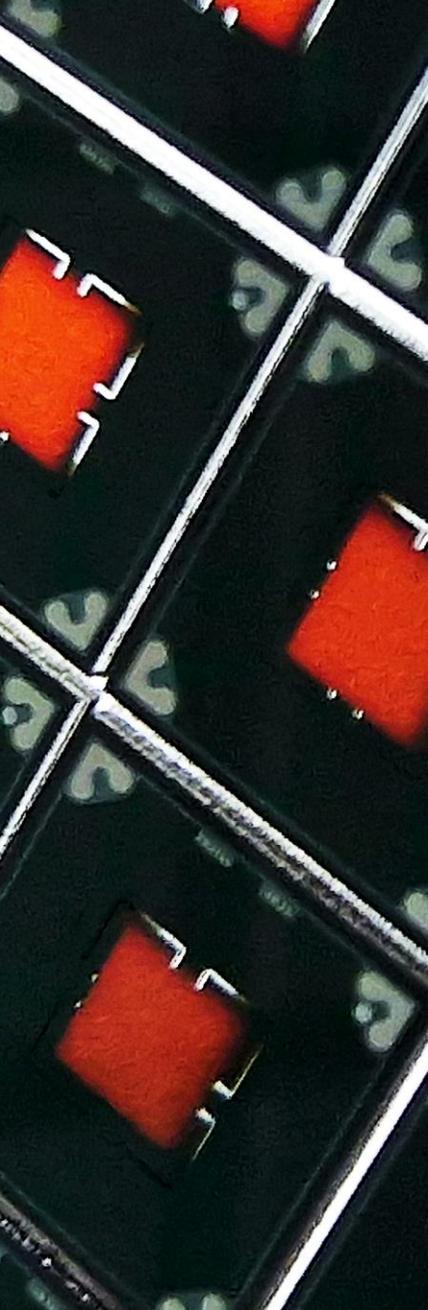
13:20 **Industrialisierung von H2MEMS - Optimierung der Technologie für kleine und mittlere Stückzahlen**

Marion Wienecke, Materion GmbH

13:45 **LTCC und LTCC-Verbundsubstrate für sensorische Anwendung unter harten Einsatzbedingungen**

Jens Müller, TU Ilmenau

14:10 **KAFFEEPAUSE**



CiS MEMS Workshop Agenda II

SESSION III

- 14:30 **Minimierung Montagespannungen auf Chip- und Sensorebene**
Johannes Zeh, Sebastian Pobering, CiS Forschungsinstitut
- 14:55 **MEMS Vibrometer: Dynamische Charakterisierung**
Jan Niklas Haus, TU Braunschweig
- 15:20 **TEM Characterisation of implantation depending crystallographic defects in pressure sensors**
Michel Simon-Najasek, Fraunhofer IMWS
- 15:45 **Virtuelles Prototyping von MEMS: Herausforderungen, Methoden und Perspektiven**
Gabriele Schrag, TU München
- 16:10 **Schlussworte und Verabschiedung**
Olaf Brodersen, CiS Forschungsinstitut
- 16:30 **Ende der Veranstaltung**

Allgemeine Informationen zum Workshop

MEMS Workshop: Neue Methoden bei der Entwicklung & Anwendung von Siliziumsensoren

REGISTRIERUNG

Bitte registrieren Sie sich online auf der Internetseite:

www.cismst.de/workshops/mems-2024/anmeldung/

Die Anmeldegebühr beträgt 200 € für die Teilnahme vor Ort (umsatzsteuerfrei).

Für eine online-Teilnahme werden 150 € fällig (umsatzsteuerfrei).

Studierende können gegen Vorlage ihres Immatrikulationsausweises kostenfrei online teilnehmen.

BEZAHLUNG

Bitte überweisen Sie die Anmeldegebühr auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: CiS e.V.

Bank: Sparkasse Mittelthüringen
IBAN: DE37 8205 1000 0130 1134 25
BIC: HELADEF1WEM

Verwendung: MEMS2024

VERANSTALTUNGSORT

CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik

Konrad-Zuse-Str. 14
99099 Erfurt

Sie reisen nach Erfurt ...

...mit **dem Auto** via Autobahn A71 und/oder A4, Ausfahrt Erfurt Ost

...mit **dem Zug** zum Erfurter Hauptbahnhof und dann Straßenbahn Linie 3

Der Workshop findet im großen Konferenzraum im 3. OG statt.

Straßenbahn Linie 3, Richtung "Urbicher Kreuz", bis Haltestelle "Windischholzhausen/ X-Fab" bis zu Fuß bis zum Gebäude des CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH (siehe Foto)

ORGANISATION

Die gesamte Korrespondenz zum Workshop richten Sie bitte an folgende Adresse:

CiS e.V.

Uta Neuhaus
Konrad-Zuse-Str. 14
99099 Erfurt

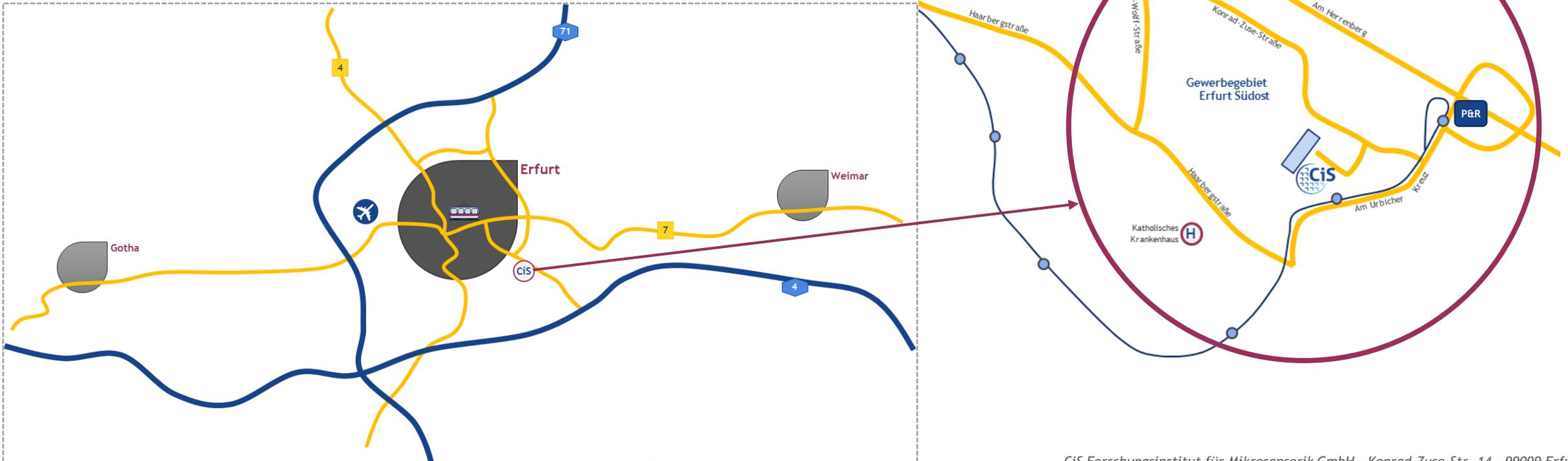
Telefon: +49 361 663 1154

E-Mail: veranstaltung@cismst.de



IHRE ANREISE ZUM CIS FORSCHUNGSINSTITUT

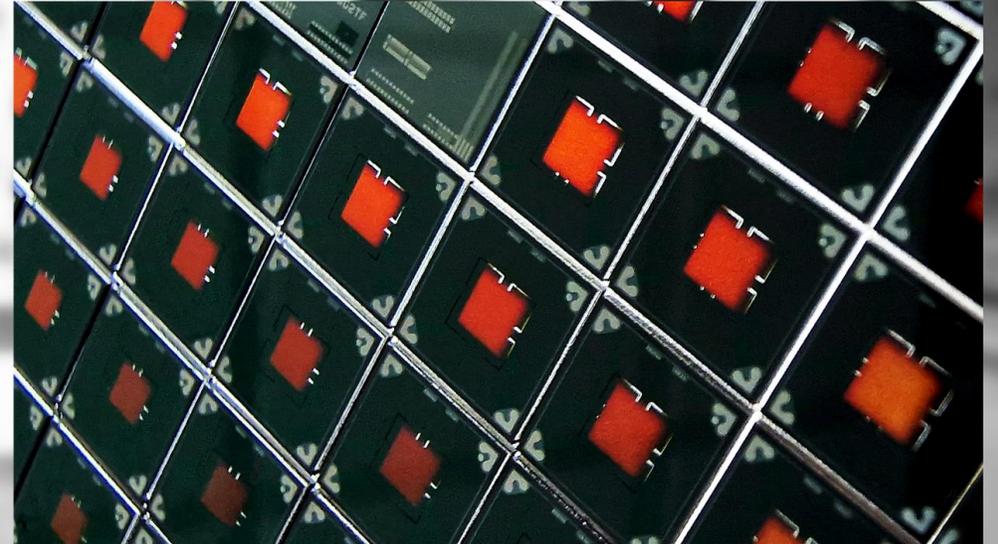
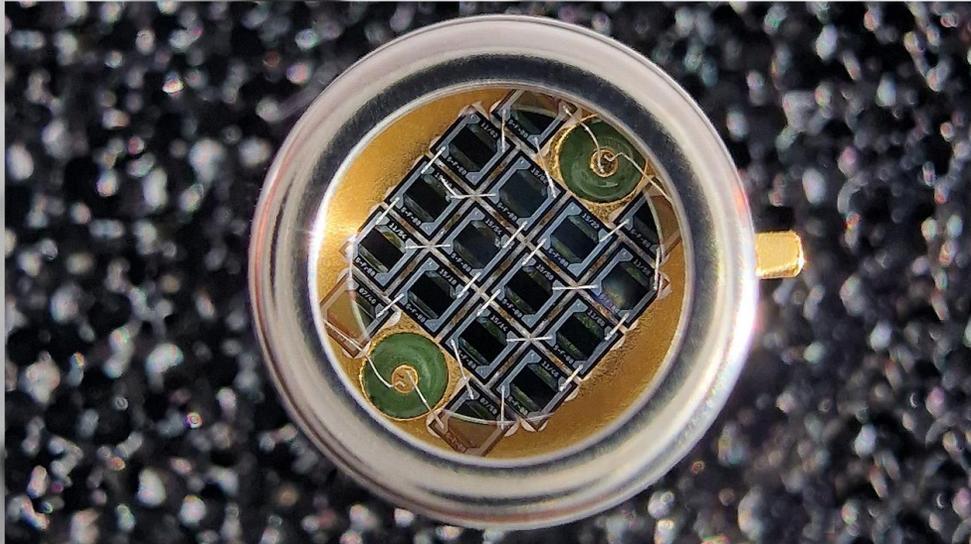
- Auto** A4 oder A71
- Bahn** Hauptbahnhof Erfurt
Straßenbahn Linie 3, Windischholzhausen / X-FAB
- Flugzeug** Flughafen Erfurt Weimar (ERF)



CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik GmbH - Konrad-Zuse-Str. 14 - 99099 Erfurt



SAVE THE DATE



CiS **MOEMS** Workshop

Mittwoch, 23. Oktober 2024

*NDIR-Sensorik von der Komponente
bis zum System (4. Auflage)*

CiS **MEMS** Workshop

Mittwoch, 6. November 2024

*Neue Methoden bei der Entwicklung &
Anwendung von Siliziumsensoren*